

AEC/APC Symposium Asia 2011
論文募集中！！ 7月15日締切
 ～「スマート・マニュファクチャリング実現のために、
 新たな出会いを求めて(ヒト・技術・産業・地域)」～
2011年11月9日(水) 学術総合センター(東京都千代田区)

<http://www.semiconportal.com/AECAPC/>

論文投稿期限:

2011年7月15日(金)

採択可否通知:

2011年8月23日(火)

最終プレゼン資料提出期限:

2011年10月19日(水) (採択者のみ)

論文投稿手順:

オンライン投稿

- AEC/APC Symposium Asia 2011 の論文投稿は全てオンライン投稿となります。投稿論文は必ず A4 サイズ 2 ページで提出して下さい。
- 投稿論文は英語表記と日本語表記の選択が可能です。但し、日本語表記の場合でも論文タイトルは英語表記が必要です。また、論文が採択された場合、9/22(木)までに英文アブストラクトをご提出頂きます。
- 1 ページ目に最大で英語の場合 1000 words、日本語の場合フォント 10.5 ポイントでテキスト文を纏めて下さい。2 ページ目に英・日どちらの場合でもデータ、図表、グラフ、写真を含めて下さい。補助資料は必須となります。
- MS Word のテンプレートを使用し、補助資料は JPEG/GIF ファイルを使用して下さい。

論文投稿に関する詳細、テンプレートは下記 website をご参照下さい。

<http://www.semiconportal.com/AECAPC/cfp.html>

事務局

株式会社セミコンダクタポータル

電話: 03-3560-3565

E-mail:

aecapc_2011@semiconportal.com

AEC/APC Symposium Asia 2011 in Tokyo, Japan

AEC/APC Symposium (AEC: Advanced Equipment Control, APC: Advanced Process Control) は、デバイス、装置、材料、ソフトウェア、センサー、メトロロジーメーカーが一堂に会し、装置・プロセスの自動診断・最適化を通じて、よりインテリジェントで高効率な生産システムの構築を議論する場を提供しています。毎年、世界 3 箇所(米 22 回・欧 11 回・亜 8 回)で開催しており、アジアでは 2007 年の日本で初の開催を機会に、台湾・日本と毎年交互開催されます。

科学的半導体生産技術の核とも呼べる AEC/APC は最先端 LSI 製造分野における製造装置利用効率及び歩留まり向上の鍵を握る重要な要素として、近年著しい成果が生まれています。また、LCD や PV 分野などのプロセス産業に広く利用できる技術です。

国内外の専門家が高度な開発の成果を発表し、AEC/APC 分野における知識や技術を交換します。半導体をはじめとするプロセス産業におけるプロフェッショナルが出会う場で、技術的交流を深めて下さい。将来の提案を含めて多くの皆様から論文投稿をお待ちしています。

半導体デバイスメーカーの前工程のみならず、後工程及び、LCD や PV などのプロセス産業のコンテンツに深く関わっている装置メーカー、ソフトウェアベンダ、センサー・メトロロジサプライヤなどで従事される皆様に始め多くの投稿をお待ちしています。

論文募集のエリア

当シンポジウムは以下のセッションにて構成される予定です。(投稿される論文数、傾向を勘案しますので、一例としてご参照ください)

- 装置・プロセス FDC と予測
- データ管理とプロセス制御
- メトロロジ、センサー、解析
- ソフトセンサー、バーチャルメトロロジ
- ファブ全体の AEC・APC、歩留まりとマルチファブアプローチ
- 標準化とロードマップ
- 将来ニーズとプロポーザル

AEC/APC Symposium Asia 2011 主催



AEC/APC Symposium Asia 2011 協賛・後援



論文募集エリアの詳細

Topics on contents related to processes and equipment

- Equipment and Process control methodology:**
 - Fault detection and classification
 - Statistical process control
 - Run-to-run control
 - Enhanced equipment quality assurance
- Productivity & tool optimizations:**
 - Throughput enhancement
 - Uptime ratio improvement
 - Cost reduction
 - Non-product wafer reduction
 - Maintenance
- Model-based process control:**
 - Physical and chemical process models
 - Model-based sensors
 - Soft sensor
 - Virtual metrology
 - Sampling plan
- Tool data analysis:**
 - Data collection
 - Data acquisition
 - Failure and Yield Analysis
 - Statistical approaches
 - Non-statistical approaches

Topics on fab level

- Data analysis, modeling and visualization:**
 - Data collection
 - Correlation analysis
 - Mathematical methods and model creation,
 - Novel methods of data visualization and data analysis
- Control methods:**
 - Run to run
 - Real-time control
 - Control algorithms
- Benefit of APC application:**
 - CoO
 - OEE
 - Yield
 - Productivity
 - Environment, safety and health
- APC Integration:**
 - Fab automation
 - Scheduling and dispatch
 - Yield management
 - Design for manufacturing
 - Supply chain management
- IT infra structure for APC:**
 - Fab-wide APC
 - Tool interfaces and communication
 - Innovative IT solutions
- APC strategy:**
 - Future Needs and opportunities

AECAPC Symposium Asia Committee

AEC/APC Symposium Asia 2011 運営委員会

- 委員長: Bradley Van Eck/ISMI
小林 秀/ルネサス エレクトロニクス
- 副委員長: 前川 耕司/PDF Solutions
- 委員: 売賀 賢介/デュラ・システムズ
内野 敏幸/ルネサス エレクトロニクス

AEC/APC Symposium Asia 2011 プログラム委員会

- 委員長: 柿沼 英則/東芝
河村 栄一/富士通セミコンダクター
- 副委員長: 有馬 澄香/筑波大学
- 委員: 栗田 裕之/ケーエルエー・テンコール
平井 都志也/ソニーセミコンダクタ九州
高山 優樹/ディーエスディー
坂本 浩一/東京エレクトロン
田中 尚人/東京エレクトロン宮城
為広 隆二/日本アイ・ピー・エム・サービス
安田 哲/パナソニック
三宅 賢治/ピーエムティー
榎並 弘充/日立ハイテクノロジーズ
黒沢 敬/山武
岩田 義雄/ルネサス エレクトロニクス (敬称略)

お問い合わせ

AEC/APC Symposium Asia 2011 事務局

株式会社セミコンダクタポータル
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22
赤坂ツインタワービル東館 17 階
電話: 03-3560-3565
Fax: 03-3560-3566
E-mail: aecapc_2011@semiconportal.com

シンポジウムスケジュールに関する詳細は下記 Web にて

<http://www.semiconportal.com/AECAPC/>

協賛企業、出展ブース、同時募集中!

過去 2 回日本で開催された、AECAPC Symposium。スポンサーシップは、第 1 回 (2007 年) 17 社、第 2 回(2009 年)9 社、サプライヤーエキシビションには第 1 回目、3 カ国 14 社、第 2 回目、2 カ国 10 社からのご協力を仰ぎました。
つきましては第 3 回目を迎える、AEC/APC Symposium Asia 2011 におきまして、スポンサーシップ、サプライヤーエキシビションへのご協力、ご参加を募っております。
まさに、フォーカスした領域のエキスパートが世界から集まる会議で、半導体生産の要の技術情報の発信地として、さらにネットワーキングの場として重要な位置づけとなります。
是非ともご検討賜りますようお願い申し上げます。